

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

ЛОТ №1

| № | Атауы | Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Өлшем бірлік | Саны |
|---|---|--|--------------|------|
| 1 | Атомдық қабатты тұндыру технологиялары нда қолдануға арналған ионды тазалау және улау жабдығы (ALD) | <p>LAD6 атомдық қабатты тұндыру (ALD) технологияларында қолдануға арналған ионды тазарту және улауға арналған жабдығы жұқа қабықшаларды қолданар алдында бетіндегі ластаушы заттарды жоғары дәлдікпен жоюды қамтамасыз ететін арнайы қондырғылар болып табылады.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Өңдеу түрі:</i> ALD алдында пластиналарды дайындау үшін беттік иондық тазалау және улау. - <i>Иондардың энергиясы:</i> иондардың энергия диапазоны 50-ден 1500 эВ-қа дейін реттеледі, бұл улау процесінің талаптарына және субстраттың түріне байланысты. - <i>Макс. өңдеу температурасы:</i> 300°C-қа дейін. - <i>Ион көзінің түрі:</i> бетті тазарту және өндеу үшін инертті газдар көзі (аргон). - <i>Улау:</i> ластануларды жою және жабынның адгезиясын жақсарту үшін бақыланатын иондық өндеу. - <i>Жұмыс қысымы:</i> процестің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін ±1% дәлдікпен камераның қысымын 10^{-4}–10^{-6} Торр деңгейінде ұстау. - <i>Энергия беру жүйесі:</i> ион энергиясын реттеу мүмкіндігі бар жоғары дәлдіктегі плазманы басқару жүйесі. - <i>Өңделетін пластинаның өлшемі:</i> 6 дюймге дейін, ALD LAD6 сәйкестігі бойынша. | дана | 1 |

№353/2024 жоба жетекшісі



Ж. Сағдолдина